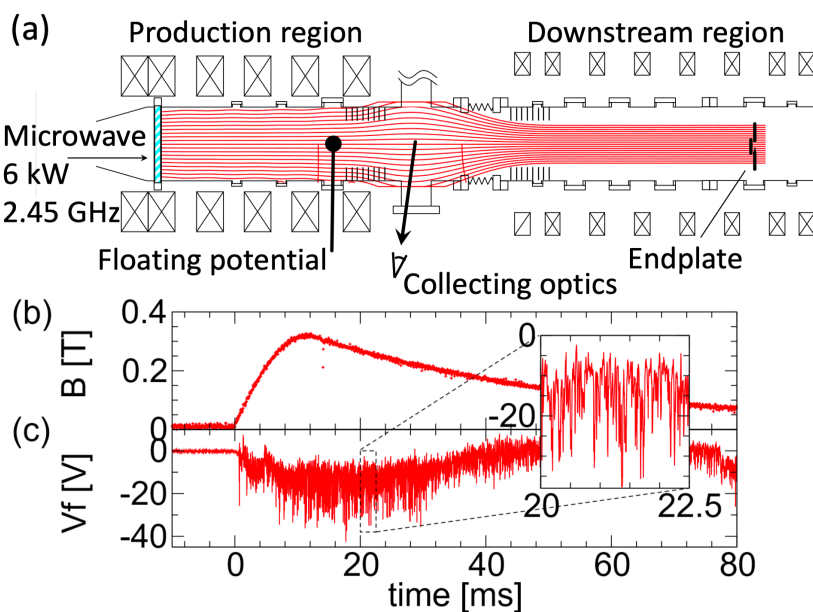


プラズマ・核融合学会誌

第101巻第7号

2025年7月

小 特 集	EUV 露光技術の動向と光源プラズマ研究・制御への要求	
	1. はじめに	富田健太郎 261
	2. 半導体量産露光機用 ハイパワー EUV 光源の現状と今後の展望	溝口 計 263
	3. ミラー汚染低減に向けた EUV 光誘起水素原子密度の計測・制御	田中のぞみ 269
	4. 多段レーザー照射による EUV 変換効率の向上	東口 武史 274
	5. CO ₂ レーザー生成スズプラズマからの極端紫外線放射の 2次元放射流体シミュレーションによる最適化 砂原 淳, Ahmed Hassanein, 富田健太郎, 難波 慎一, 東口 武史	280
	6. おわりに	富田健太郎 287
Plasma and Fusion Research 掲載論文アブストラクト		289
インフォメーション		290
	ITPA (国際トカマク物理活動) 会合報告(89)	
	ITER だより(112)	
	【人事公募】	
本 会 記 事		297
	国際会議参加に関わる若手研究者支援に対する採択の結果	
	学会ホームページ:「会員専用ページ」パスワードのお知らせ	
編 集 後 記		



表紙の絵

電子サイクロトロン共鳴プラズマ実験装置 NUMBER において、浮遊電位に生じる負のスパイクで条件付き抽出したドップラー分光計測により、イオン温度が低下していることを明らかにした。(a)浮遊電位とドップラー分光の計測位置を装置概念図に示す。(b)下流の一樣磁場領域の磁場強度が時間変化する放電で、(c)浮遊電位の時間発展を拡大すると負方向にスパイクが生じている。

(Yuto YAMADA *et al.*, Plasma and Fusion Research, Vol. 20, 1201027 (2025) <https://www.jspf.or.jp/>)

【複写をされる方へ】本学会は、本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委託しています。本誌に掲載された著作物の複写をご希望の方は、(社)学術著作権協会より許諾を受けてください。但し、企業等法人による社内利用目的複写については、当該企業等法人が公益社団法人日本複製権センター(社)学術著作権協会が社内利用目的複写に関する権利を再委託している団体)と包括複写許諾契約を締結している場合にあっては、その必要はありません(社外頒布用の複写については許諾が必要です)。

権利委託先：一般社団法人学術著作権協会 〒107-0052東京都港区赤坂9-6-41乃木坂ビル2F

複写以外の許諾(著作物の引用、転載、翻訳等)に関しては、(社)学術著作権協会に委託しておりません。直接当学会へお問い合わせください。